

立即发布

投资者关系：

Ed Lockwood

投资者关系高级总监

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒体关系：

Meggan Powers

企业宣传高级总监

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-TENCOR 推出新的 TeraFab™HT 和

eDR™-5210S，完善光罩缺陷管理系列产品

【加州 MILPITAS 2010 年 7 月 12 日讯】今天，专为半导体和相关产业提供工艺控制与成品率管理解决方案的全球领先供应商 [KLA-Tencor Corporation® \(NASDAQ: KLAC\)](#) 推出了 [TeraFab™HT](#) 光罩检测和 [eDR™-5210S](#) 晶片缺陷再检查设备。这些新的设备经过专门设计，通过检测光罩缺陷提供预警，并在发现光罩缺陷后迅速准确地处理晶圆，可以帮助处于领先地位的半导体代工工厂及其他先进的芯片生产厂解决随着关键尺寸减小而日益严重的光罩污染问题。

设备生产期间，光罩上存在污染物是灾难性的，因为污染物有可能导致由该光罩刻印的每个芯片上的缺陷。一般而言，最具成本效益的控制策略就是，在该光罩污染物缺陷尚未大得足以在晶圆上造成缺陷之前，首先在光罩上发现它们。在光罩上发现污染物后，就将该光罩送去清洁，并重新检验合格，同时检查最近刻印的晶圆有无缺陷。

KLA-Tencor 的首席工程师兼光罩检测与电子束技术事业群副总裁 Zain Saidin 表示：“我们的尖端客户在光罩污染控制方面正在面临两大难题。首先，半导体厂商需要适合每代设备的更高的光罩检测灵敏度：随着线宽缩小、更小的光罩上的缺陷和晶圆上的更小缺陷会影响成品率。其次，对晶圆上由光罩引起的缺陷进行检查这一程序需要大幅提速，以便能够对在统计学上具有代表性数量的芯片进行检查，并且能够准确判断出由光罩引起缺陷的芯片数量——甚至是在领先的半导体工厂的极端出货周期压力之下。没有必要地废弃晶圆会造成巨大损失——或者更糟的是，让其带着尚未发现的缺陷而传递到下一个流程步骤。我们的 TeraFabHT 和 eDR-5210S 系统经过专门设计，可以解决这些关键问题。”

TeraFabHT 光罩检测系统比上一代 TeraFab 的激光、传感器、光学路径与信号处理算法大幅改进，包括 KLA-Tencor 获得专利的 *STARlight*[™] 模式，它实现了以下功能：

- 检测灵敏度与生产能力比上一代 TeraFab 和 SLQ 光罩缺陷检测系统更高
- 能够对单晶圆和多产品光罩进行检验，能够对使用新颖材料（例如不透明的玻璃基 MoSi [OMOG]）的尖端光罩类型进行检验，能够对采用极小光学邻近效应校正 (OPC) 技术的光罩进行检验
- 多达三个灵敏度与速度设置，以更具成本效益的方式检验各种设备节点的关键与非关键光罩

eDR-5210S 电子束晶圆缺陷再检查系统拥有高分辨率、无与伦比的机台精确度、新型算法以

及与 TeraFabHT 的独特连通性，使之具备以下能力：

- 创新的光罩缺陷检查 (RDR) 模式，将光罩无缝转化为晶圆坐标，从而让对可能由光罩导致的缺陷部位进行检查大幅简化和加快
- 对光罩导致的各种晶圆刻印缺陷类型进行特征描述
- 使用 TeraFabHT 提供的关于掩膜板定位与缺陷特征描述的专有数据提高晶圆处理的速度和精确度

KLA-Tencor 的 TeraFabHT 光罩检测系统和 eDR-5210S 晶圆缺陷检查设备既可作为新系统购买，也可作为上一代检测与再检查设备的现场升级。两款设备均与 KLA-Tencor 业界领先的 28xx 宽波段晶圆检测系统及 Klarity® 缺陷数据管理和分析系统兼容，可实现对光罩引发缺陷的全面监测及整个半导体工厂光罩缺陷历史记录的有效追踪。为保持较高性能和产能，TeraFabHT 和 eDR-5210S 设备由 KLA-Tencor 的全球综合服务网络提供支持，并且 eDR-5210S 还由 [KlearPoint™](#) 客户端服务器实时设备监测系统提供进一步支持。若要了解关于 KLA-Tencor 的光罩管理解决方案或组成该套件的个别设备，请访问产品网页：

<http://www.kla-tencor.com/metrology/XYZ.html> 和 <http://www.kla-tencor.com/metrology/XYZ.html>。

关于 KLA-Tencor：

KLA-Tencor 公司 (纳斯达克股票代码 : KLAC) 是工艺控制与成品率管理解决方案的领先提供商 , 它与全球客户合作 , 开发先进的检测与度量技术。这些技术为半导体、数据存储、LED、光伏及其他相关纳米电子产业提供服务。公司拥有广泛的业界标准产品系列及世界一流的工程师与科学家团队 , 三十余年来为客户努力打造优秀的解决方案。KLA-Tencor 的总部设在美国加利福尼亚州 Milpitas , 并在全球各地设有专属的客户运营与服务中心。如需更多信息 , 请访问网站 www.kla-tencor.com。(KLAC-P)

前瞻性声明 :

本新闻稿中除历史事实以外的声明 , 例如关于 TeraFabHT 和 eDR-5210S 的预期性能 , 半导体产业的未来发展与趋势及其带来的预期挑战 , KLA-Tencor 的客户对 TeraFabHT 和 eDR-5210S 的预期使用 , 以及 TeraFabHT 和 eDR-5210S 设备使用者可以实现的预期成本、运营与其他受益等陈述 , 均为前瞻性声明 , 并受到《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 规定的“安全港”(Safe Harbor) 条款的制约。这些前瞻性声明基于当前信息及预期 , 且包含诸多风险与不确定性。由于各种因素 , 包括延迟采用新技术 (无论是由于成本或性能问题抑或其他问题) , 其他公司推出竞争性产品 , 或影响 KLA-Tencor 产品的实现、性能或使用的意外技术挑战或限制 , 因此实际结果可能与此类声明中的预计结果实质不同。

###